

「次世代プリントドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発」(中間評価)

今後の予定

平成27年9月15日(火) 9:30~18:00

評価分科会(後日、議事録の確認作業を別途お願いします。)

質問受付・質問回答

平成27年9月17日(木)

質問票の提出(評価委員)

提出先:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 坂部 至 宛

※質問票への回答(推進・実施者)は9月25日(金)までに評価部 坂部へ提出

評価コメントの作成・取り纏め

平成27年9月30日(水)

評価コメント及び評点票の提出(評価委員)

提出先:国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

坂部 至 宛

平成27年10月13日(火)頃まで

評価書(案)の取り纏め(委員長・事務局)後、評価委員に配布

平成27年10月20日(火)頃まで

評価書(案)の確認・了承(評価委員)後、推進・実施者に配布

評価コメント応答

平成27年10月27日(火)頃まで

推進・実施者意見書(事実誤認の確認、補足説明)の作成(推進・実施者)

平成27年11月4日(水)

推進・実施者意見書を踏まえ、評価報告書(案)の確定(評価委員)

評価報告書の確定

研究評価委員会にて評価報告書(案)を審議、承認の上、確定。